

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成16年12月2日(2004.12.2)

【公表番号】特表2001-501317(P2001-501317A)

【公表日】平成13年1月30日(2001.1.30)

【出願番号】特願平9-535322

【国際特許分類第7版】

G 0 2 B 27/28

G 0 2 F 1/13

【F I】

G 0 2 B 27/28 Z

G 0 2 F 1/13 5 0 5

【手続補正書】

【提出日】平成16年3月11日(2004.3.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

手続補正書



平成16年 3月11日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

平成09年特許願第535322号

2. 補正をする者

氏名(名称) ミネソタ・マイニング・アンド・
マニュファクチャリング・カンパニー

3. 代理人

住所 〒540-0001
大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMPビル
青山特許事務所
電話 06-6949-1261 FAX 06-6949-0361

氏名 弁理士 (6214) 青山 葆



4. 補正対象書類名 請求の範囲

5. 補正対象項目名 請求の範囲

6. 補正の内容
別紙の通り

請 求 の 範 囲

1. 第1の反射面と、

前記第1の反射面に大略対向している第2の反射面と、

第一の複数のプリズム溝を有する表面を備えて複数の光線を入力ビームから前記第1の反射面及び第2の反射面にそらせる第1のマイクロプリズムエレメントと、

第二の複数のプリズム溝を有する表面を備えて前記第1の反射面及び第2の反射面で反射した複数の光線を集めて前記集められた光を出口ビームに視準する第2のマイクロプリズムエレメントと、

を備える、複数の光線を含む少なくとも2つの視準された光ビームを空間積算するための物品。

2. 前記第1の反射面及び第2の反射面が、第1の反射された楔プリズム及び第2の反射された楔プリズム上にそれぞれ形成されている、請求項1記載の物品。

3. 光源と、

前記光源から入力ビームへ光を視準するための手段と、

第1の偏光状態を有する第1のビームと、第2の偏光状態を有する第2のビームとに前記入力ビームを分離するための手段と、

前記第1のビームを前記第1の偏光状態から前記第2の偏光状態に変換するための手段と、

前記出口ビームのアスペクト比を変換するための手段と、

前記第1のビーム及び第2のビームを空間積算して、視準された出口ビームを作成する請求項1記載の物品と、

を備える偏光照明システム。

4. 前記出口ビームのアスペクト比を変換するための手段とをさらに備える、請求項3記載の偏光照明システム。

5. 請求項1記載の物品を備えるとともに、さらに、

光源と、

前記光源から入力ビームに光を視準するための手段と、

第1の偏光状態を有する第1のビームと、第2の偏光状態を有する第2のビー

ムとに前記入口ビームを分離するための手段と、

前記第1のビームを前記第1の偏光状態から前記第2の偏光状態に変換する前記分離手段に近接した半波リターダと、

前記出口エレメントに付けられた第1のビーム圧縮エレメントと、前記第1のビーム圧縮エレメントに近接配置された第2のビーム圧縮エレメントとを含む、前記出口ビームの前記アスペクト比を変更するための手段と、

前記変更されたアスペクト比を有する前記出口ビームを受け取るために配置された表示手段と、

投射レンズと、

前記表示手段から前記投射レンズに光を向けるために配置された対物レンズと、を備える電子プロジェクター。